

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach projektu: Inwestycja: A2.4.1 Inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Przedsięwzięcie: Centrum Kompetencji Mikroelektronika i Fotonika, Nr umowy KPOD.01.18-IW.03-0011/23

Public Procurement Office
620745-2025
Dz.U. S: 182/2025

CONTRACT NOTICE

Supplies

Łukasiewicz Research Network – Institute of Microelectronics and Photonics

02-668 Warsaw, 32/46 Lotników Av.

website: <http://imif.lukasiewicz.gov.pl/>

I. CONTRACTING AUTHORITY

Łukasiewicz Research Network – Institute of Microelectronics and Photonics, 02-668 Warsaw, 32/46 Lotników Av. Attn: Agata Zyglar, e-mail: agata.zyglar@imif.lukasiewicz.gov.pl

Further information can be obtained at:

Łukasiewicz Research Network – Institute of Microelectronics and Photonics, 02-668 Warsaw, 32/46 Lotników Av. Attn: Agata Zyglar, e-mail: agata.zyglar@imif.lukasiewicz.gov.pl

Specifications and additional documents can be obtained at:

<https://platformazakupowa.pl/pn/imif>

In this proceeding, all declarations, applications, notifications and information shall be transmitted via the Purchasing Platform <https://platformazakupowa.pl/pn/imif>, agata.zyglar@imif.lukasiewicz.gov.pl

Tenders or requests to participate must be sent to:

<https://platformazakupowa.pl/pn/imif>

II. THE OBJECT OF THE ORDER

The object of the order for **delivery of a plasma etching unit (RIE) with an automatic loadlock cover.**

III . EVALUATION OF THE TENDER

- Price - 100 %

IV. TENDER

Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:

21.10.2025 – 09:00.

23.09.2025